

LDP2000

SÉRIE DE PURIFICATEURS DE GAZ À DOUBLE GETTER À HAUT DÉBIT



LDP2000

LDP2000 est un purificateur sub-ppb utilisé pour générer du gaz d'étalonnage de haute pureté pour les analyseurs en ligne ainsi que du gaz vecteur de haute pureté pour les systèmes de chromatographie en phase gazeuse. Conçue avec deux étapes de purification à température contrôlée, cette série de purificateurs garantit une pureté de grade 9,0 (99,9999999 %) à sa sortie. Commutation automatique de ses deux Getters permet à cette série d'alimenter plusieurs instruments à partir d'une seule source sans interruption.

CARACTÉRISTIQUES :

- Débits élevés jusqu'à 20 LPM pour alimenter plusieurs instruments analytiques
- Mode de régénération préprogrammé et disponible
- Deux getter montés en parallèle avec commutation automatique via un réseau de vannes pneumatiques en cas d'alarme de niveau de pureté pour éviter toute interruption du débit
- Surveillance en temps réel de la qualité du gaz grâce à un mini-PED (détecteur d'émission de plasma) intégré à l'appareil pour surveiller les traces de N2 et H2O à la sortie du purificateur (en option)
- Alarmes de niveau de pureté et d'état
- Port série
- Écran LCD de diagnostic et clavier
- LED d'indication
- Getter interchangeable

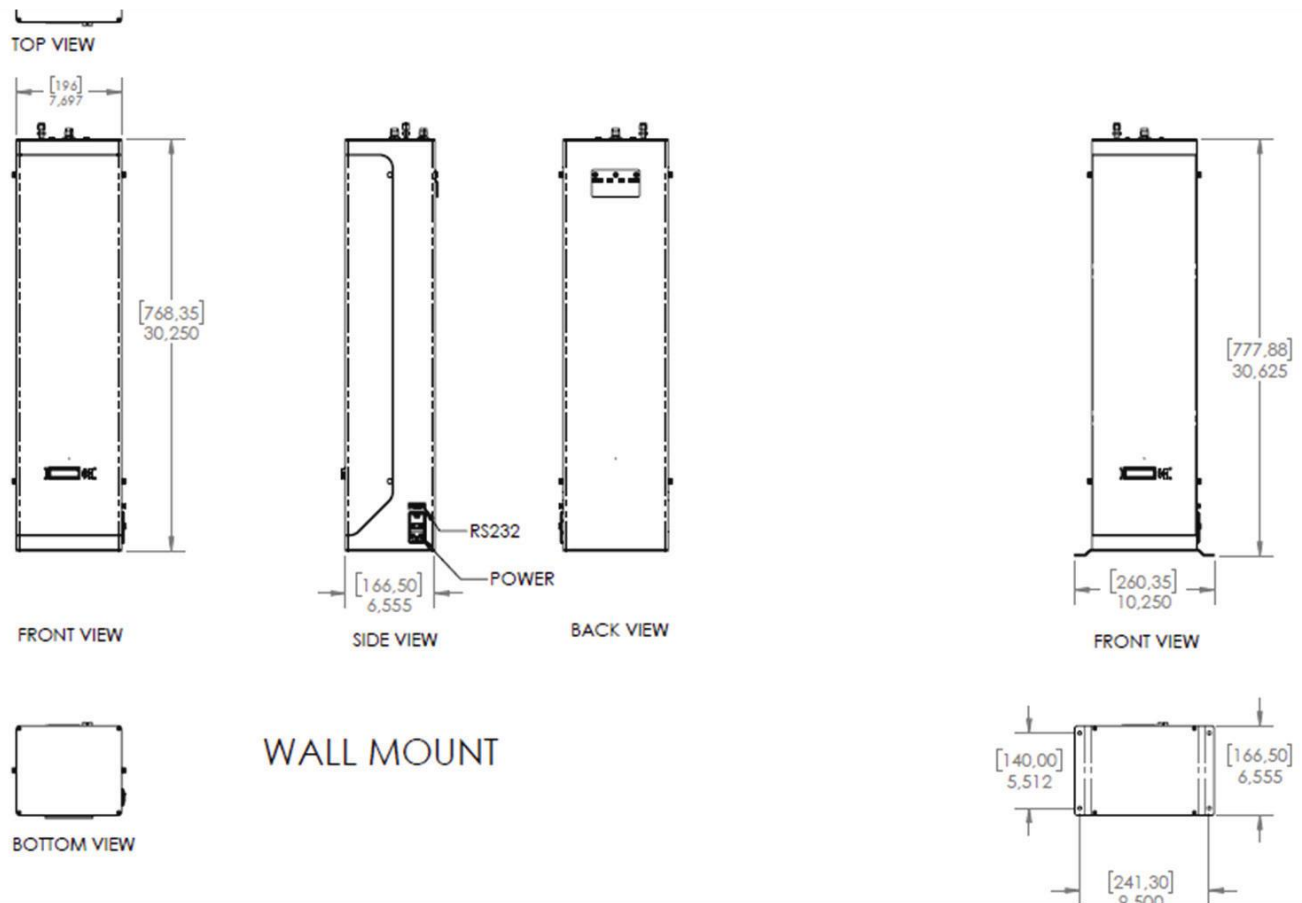
SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GETTER Combinaison de différents alliages de Zr/V/Fe/Pd avec 2 étapes de purification					
GAZ PURIFIÉS:	Gaz nobles	Azote	Hydrogène	Dioxyde de carbone	Oxygène
IMPURETÉS ÉLIMINÉES À TEMPÉRATURE AMBIANTE	H2O, O2, CO, CO2, H2			H2O, O2, THC	H2, H2O, CO, CO2, CH4, NMHC
IMPURETÉS ÉLIMINÉES LORS DES DEUX ÉTAPES DU CHAUFFAGE	H2O, O2, CO, CO2, N2, NMHC, H2, CH4	H2O, O2, CO, CO2, NMHC, H2, CH4	H2O, O2, CO, CO2, N2, THC	n/a	n/a
MODE DE RÉGÉNÉRATION DISPONIBLE	n/a	n/a	n/a	Oui	Oui
SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL DES TRACES DE N2-H2O À AVEC PED DISPONIBLE	Oui	n/a	n/a	n/a	n/a
NIVEAU D'IMPURITÉS À LA SORTIE	<1ppb				
DÉBIT	2 L/min nominal jusqu'à 20 L/min maximum				
RACCORDS DE GAZ	1/4" VCR (à étanchéité de surface)				
PLAGE DE PRESSION D'ENTRÉE RECOMMANDÉE	50psig-200psig (345kpag-1379kpag)				
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	110/120VAC 50/60Hz ou 220/240VAC 50/60Hz				
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	Au démarrage: 300 Watts max, Opération normale: 200 Watts max				
POIDS	35LBS (15.9KGS)				

CERTIFICATION

CE & UKCA Conforme aux directives EMC: IEC 61000-6-2: 2016 (immunité) & IEC 61000-6-4: 2018 (émission) pour les équipements utilisés dans un environnement industriel.

DIMENSIONS



INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT TYPIQUES

Le système de purification de gaz à double getter LDP2000 est conçu pour alimenter en gaz vecteur plusieurs instruments d'analyse. Le fait de disposer d'un seul appareil de purification pour alimenter plusieurs instruments simplifie les opérations et réduit les coûts d'entretien et d'installation.

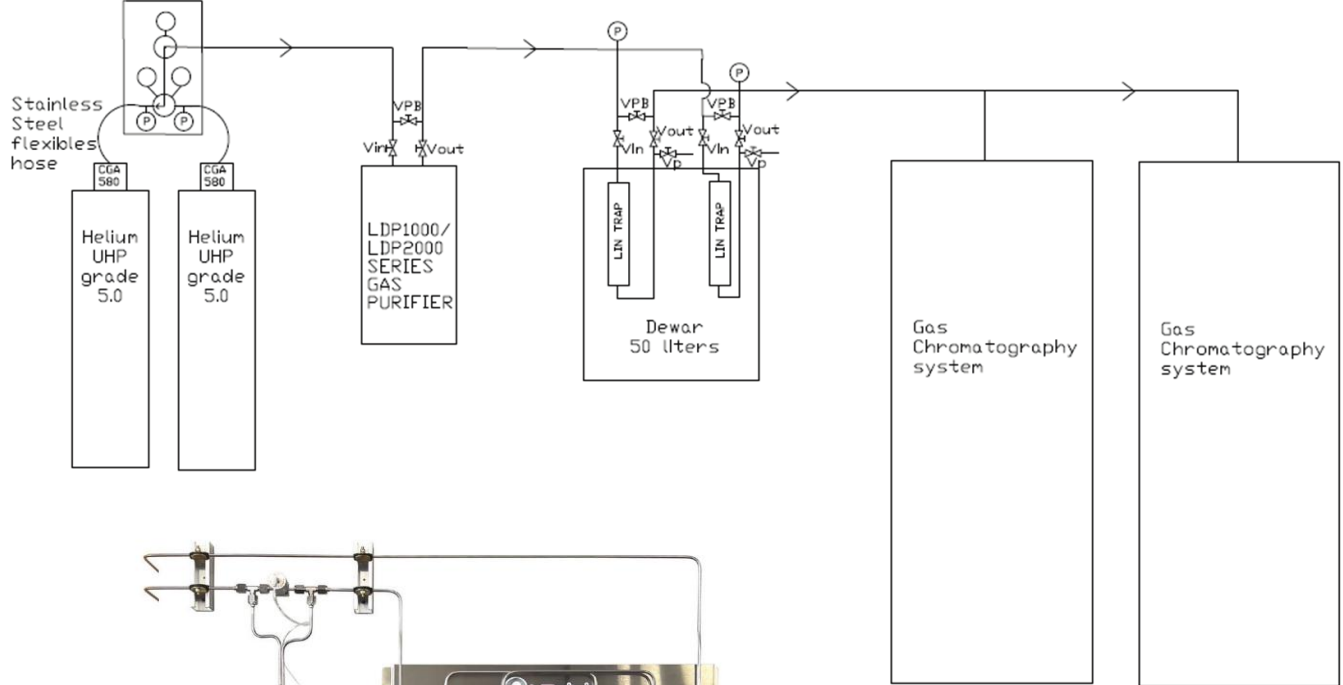
Grâce à notre mini-détecteur à émission plasma monté à la sortie du purificateur pour détecter les impuretés ppb N₂ et H₂O en mode hélium ou argon, il offre une surveillance en ligne de la qualité réelle du gaz généré. Si l'alarme de niveau de pureté est activée en raison de la détection d'impuretés, le dispositif passe automatiquement au getter de secours pour continuer à alimenter les instruments d'analyse sans interruption. Le getter saturé est alors refroidi et isolé pour permettre son remplacement sans difficulté.

L'appareil est équipé d'un écran LCD frontal avec clavier pour naviguer dans son interface.

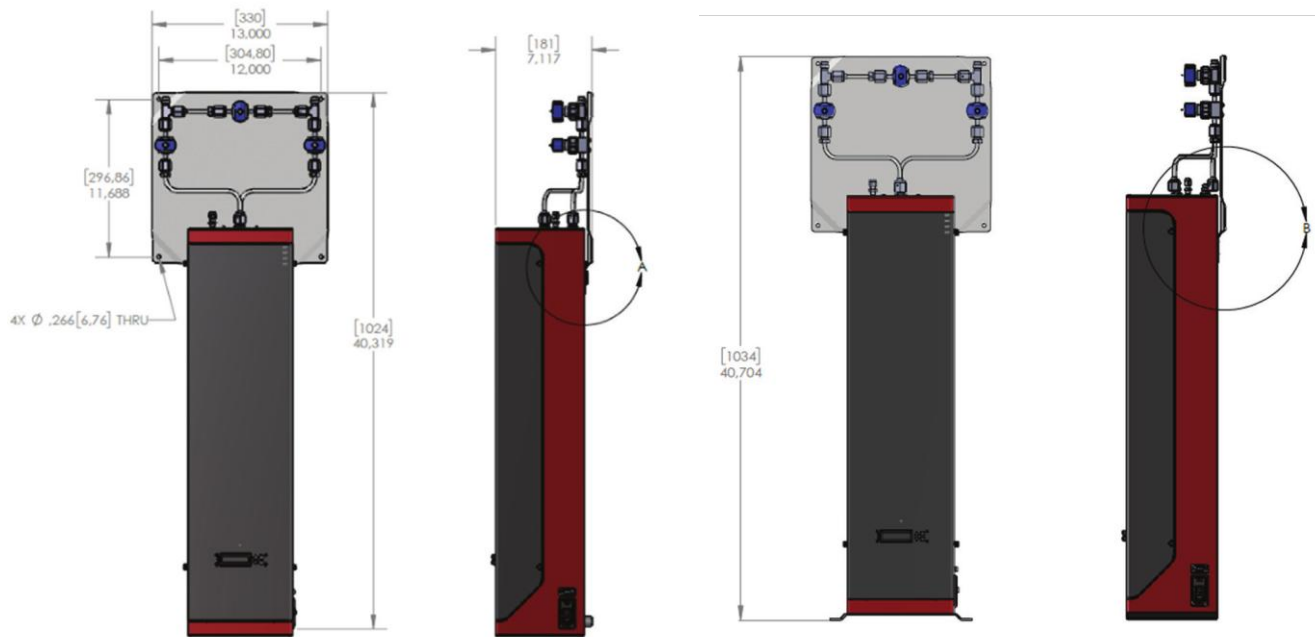
Le schéma représente une installation typique de chromatographie en phase gazeuse comportant plusieurs GC. Un système de commutation (LDASS) avec un système de surveillance de la pression (LDPMS) sont utilisés pour assurer la surveillance de la pression des bouteilles avant le purificateur de gaz LDP2000. À la sortie du purificateur de gaz LDP2000, notre système de purification cryogénique (LDCRYO) est monté pour éliminer les traces d'argon présentes dans la source d'hélium. La combinaison des trois systèmes constitue la meilleure solution pour alimenter en gaz de haute qualité tous les systèmes de chromatographie en phase gazeuse.

Automatic switchover system LDASS + LDPMS pressure monitoring system & alarms

Cryogenic dual trap system for carrier gas purification LDCryo + LDPMS pressure monitoring system & alarms



OPTIONS DE PLAQUE DE MONTAGE



WALL MOUNT

SHELF MOUNT

INFORMATION À INDIQUER SUR LA COMMANDE

LDP2000	-XXX	-X	-X	-X	-XX	-XXXX
	Tension de fonctionnement: 120 : 120VAC 240 : 240VAC	Type de gaz: N : Gaz nobles N2 : azote H2 : hydrogène O2 : oxygène CO2 : dioxyde de carbone	Taille des raccords de gaz: 4 : ¼"	Type de raccords: C : Compression FS : à joint de surface	Plaque de support: WM : Support mural en acier inoxydable SM : Support d'étagère en acier inoxydable	Configuration des vannes de la plaque de support : BP4C : vanne bypass seulement à compression ¼" BPI04C : bypass, d'entrée & de sortie à compression ¼" BP4FS : vanne bypass seulement à joint de surface ¼" BPI04FS : bypass, d'entrée & de sortie à joint de surface ¼"